**表面分析士（認定・認定変更）申請書**

下記のように、表面分析士認定（認定内容変更）の申請をいたします。

申請手続き費用： 認定時　３，０００円＋消費税

変更時　１，０００円＋消費税

（事務局記入）受付日：　　　　　　　受付番号：

1. 氏　　名　： 　　　　　　　　　　　　　　　　印

2. 申請年月日： 　　　　　年　　　　月　　　　日

3. 所属機関　：

4. 所属部署　：

5. 連絡先（所属機関所在地または自宅住所のいずれか）：

〒

6. 電話： 　　　　　 FAX：

7. 電子メール：　　　　　　　　　　　　＠

8. 申請技術分野一覧

※ 下の一覧を参照の上、［9. 認定要件まとめ］の表で申請したい技術名称を○で囲む。  
複数選択可。［5-3 SPMその他］を選択した場合は、申請を希望するSPM関連技術名称を記入欄に記述する。

1. Ｘ線光電子分光法 （XPS: X-ray Photoelectron Spectroscopy）

2. オージェ電子分光法 （AES: Auger Electron Spectroscopy）

3. 二次イオン質量分析法 （SIMS: Secondary Ion Mass Spectrometry）

3-1 D-SIMS: Dynamic SIMS

3-2 TOF-SIMS: Time of Flight SIMS

4. 電子線マイクロアナリシス （EPMA: Electron Probe Microanalysis）

4-1 WDX: Wavelength Dispersive X-ray Spectrometry（波長分散型分光法）

4-2 EDX: Energy Dispersive X-ray Spectrometry（エネルギー分散型分光法）

5. 走査プローブ顕微鏡法 （SPM： Scanning Probe Microscopy）

5-1 AFM: Atomic Force Microscopy（原子間力顕微鏡）

5-2 STM: Scanning Tunneling Microscopy（走査トンネル顕微鏡）

5-3 その他（申請を希望するSPM関連技術名称を下の記入欄に記述）

記入欄

9. 認定要件まとめ：

※ 申請技術を○で囲み、該当する欄に件数等を記入する。

※ISOセミナーの受講、国内会議発表、国際会議発表、JSA論文掲載は全申請技術を通して、各要件について1件以上を必須とするが、全ての技術に対して全要件が1件以上である必要はない。

※ 実務経験を客観的に示すための推薦書（提出は必須ではない）がある場合は、該当欄にチェックする。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請技術 | | 実務経験を客観的に示すための要件（[ ] 内はSASJ活動に関わる件数） | | | | | | | | |
| 学術誌（査読有のみ）への 論文掲載数  （[ ]内はJSA誌の査読付き  記事掲載数） | | | | 学会発表件数  （[ ]内はSASJ主催の国内会議（定例研究会と国内PSA）と国際会議（PSAとiSASなど）での発表件数） | | | | 推薦状  （該当に  チェック） |
| 英語 | | 日本語 | | 国内 | | 国際 | |
| XPS | |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] | □ |
| AES | |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] | □ |
| SIMS | D-SIMS |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] | □ |
| TOF-SIMS |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] | □ |
| EPMA | WDX |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] | □ |
| EDX |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] | □ |
| SPM | AFM |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] | □ |
| STM |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] | □ |
|  |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] | □ |
|  |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] | □ |
| ISOセミナー受講年度 | | | |  | | | | | | |

認定委員会記入欄

　　　　　年　　　月　　　日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委員１ | 委員２ | 委員３ | 委員４ | 委員５ | 委員６ | 総合判定 |
| 可否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 署名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 否認の場合は改善すべき点を記載（委員名：　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

注： 印刷して記入署名後、スキャンファイルを標準化活動部会宛に電子メールで送付下さい。

**実務経歴書 （申請技術：　　　　　　　）**

※ 申請技術ごとに1ページ以内で作成すること。

※ 客観的な根拠資料となる論文や学会アブストのコピーを、付属資料として番号をつけて添付すること。  
付属資料の様式は問わない。

申請者氏名：

記入年月日：　　　　　年　　　月　　　日

【具体的実務経歴】

※具体的実務の内容を3件程度記述。各々数行で記述すること。

例）　○○○○　－　○○○○　年、△△△法による×××の分析に従事、付属資料番号[1, 2, 3... ]

１）

２）

３）

【表面分析研究会の活動に関わる実績】

※申請書に記載されていない特記事項を記載。たとえばセミナーや研究会での講師など。

【表面分析の標準化活動に関わる実績】

※RRTへの参画（単なる測定データの提供など、主体的でない活動は不可）、JIS作成など。